

科技之家 (China)

NEW MULTI-FUNCTIONAL MICRO- AND NANOIMPRINT SOLUTION FROM EV GROUP OFFERS UNPRECEDENTED FLEXIBILITY FOR HIGH-VOLUME OPTICAL DEVICE MANUFACTURING – January 19, 2022

EV Group (EVG), a leading supplier of wafer bonding and lithography equipment for the MEMS, nanotechnology and semiconductor markets, today introduced the EVG[®]7300 automated SmartNIL[®] nanoimprint and wafer-level optics system. The EVG7300 is the company's most advanced solution to combine multiple UV-based process capabilities, such as nanoimprint lithography (NIL), lens molding and lens stacking (UV bonding), in a single platform. This industry-ready, multi-functional system is designed to serve advanced R&D and production needs for a wide range of emerging applications involving micro- and nano-patterning as well as functional layer stacking.

科技之家

科技 物联网 电商 智能制造 虚拟技术 数据 人类 探索

科技之家 科技 正文

EV集团新型多功能纳米压印解决方案为大批量光学设备制造赋予前所未有的灵活性

2022年1月19日 编辑: 孙海松

EVG7300是EV集团最先进的解决方案,能够在单个平台中结合多种紫外工艺,包括纳米压印光刻(NIL)、透镜成型和透镜堆叠(UV bonding)。

2022年1月19日,奥地利维也纳 – 微机电系统(MEMS)、纳米技术和半导体市场晶圆键合与光刻设备领先供应商EV集团(EVG) 推出了EVG7300自动SmartNIL纳米压印与晶圆级光学系统。EVG7300是EV集团最先进的解决方案,在单个平台中结合了多种紫外工艺技术,包括纳米压印光刻(NIL)、镜片成型和透镜堆叠(紫外键合)。该系统行业领先的多功能系统旨在满足多种新兴应用的研究和生产需求。这些新兴应用大多涉及微米和纳米级精度以及功能层堆叠技术,包括晶圆级光学系统(WLO)、光学传感器和投影仪、汽车照明、增强现实耳镜设备、生物医学设备、超透镜和透镜,以及光子学应用。EVG7300支持最大300毫米晶圆尺寸,具有高精度调整,先进工艺控制和高吞吐量等优势,可满足多种自由曲面和高精度纳米和微光学元件与组件的大批量制造需求。



EVG7300 SmartNIL纳米压印与晶圆级光学系统在一个平台中结合了多种紫外工艺技术,是业界领先的多功能解决方案。

EV集团企业技术总监托马斯·格林纳(Thomas Glinner)表示:“EV集团深厚的纳米压印技术拥有二十余年,我们持续投入大量资源进行研发,开发出创新解决方案,满足不断变化的客户需求。EVG7300是EV集团纳米压印解决方案系列的最新成员,将我们的SmartNIL全球领先技术与透镜成型和透镜堆叠技术结合于顶级系统,拥有市场上最精确的商家和工艺参数控制功能,为我们的客户带来了前所未有的灵活性,足以满足行业研究和生产需求。”

EVG7300系统既可作为独立工具,也可用作EV集团HERCULES NIL全圆成型UV-NIL晶圆解决方案中的集成模块。UV-NIL解决方案可增加部分制造步骤,例如晶圆处理,保护性涂覆,和透镜成型等,以满足特定工艺的光学需求。EVG7300系统结合了改善平台改进,增强激光光学,多点伺服控制,非接触式测头和多点力的控制技术,达到了业内领先的测量精度(最佳可达300纳米)。EVG7300是一种高度灵活的平台,提供三种工艺模式(透镜成型,透镜堆叠和SmartNIL纳米压印),支持从150毫米到300毫米圆形的基板尺寸。该高级平台能够快速加载印刷机和晶圆,快速调整光学组件,提供高吞吐量功能,且工具尺寸小巧,能够充分满足行业对新型晶圆级光学系统(WLO)产品的制造需求。



SmartNIL系统除了能够完成传统纳米压印和透镜成型外,还能够完成UV-NIL晶圆键合

产品上市信息

EV集团现已开始接受该系统的订单,同时,可在EV集团总部NIL Photonics技术中心观看产品演示。

关于EV集团(EVG)

EV集团(EVG)是半导体、微机电系统(MEMS)、化合物半导体、功率器件和纳米技术器件制造提供设备与工艺解决方案的领先供应商。主要产品包括:晶圆键合、晶圆处理、光刻/光刻纳米压印(NIL)与计量设备,以及光刻胶涂布机、清洗和检测系统。EV集团成立于1980年,可为全球各地的客户和合作伙伴网络提供服务与支持。

<http://www.etechome.com/v1/245313.aspx>